

## \* 理研での作業期間

\* 2/24 (Fri) - 2/26 (Sun)

## \* 2/27 (Mon) ~ 3/1 (Thurs)

\* 前期入試採点

## \* HODF の dynamic range

\* HV/gain: 1 MeVee ~ 300 mV (after amp) into discri

\*  $V_{th}(\text{disc}) \sim 80 \text{ mV} \leftrightarrow 0.17 \text{ MeVee}$ 

\* ADC への attenuator : 10 db

\* Pedestal を考慮すると ADC range ~ 190 MeV

\* ~Z=7 に対応 (少し切れる)。Z=6 は問題無く入るはず

\* Q-ADC V792 を繋ぐと DC offset (10~20mV) がつく。

\* HODF は問題無いが、HODP の pedestal が変。

## \* 準備不足

\* 色々不足している物があるので注文

\* ガス系について再考

\* バラトロンモニターパネル製作

## \* 2/24 (Fri) ~ 2/25 (Sat)

## \* FDC2

\* Ar+50%C2H6 へ置換中 : 約3回置換

\* HV 試験 : &lt; 2.9 kV

\* 2.8~2.9 kV では不安定

\* @2.8 kV: 20 nA(X), 120 nA(U), 50 nA(V)

## \* FDC1

\* 外箱内部の配線変更 : バイパス追加

\* 圧力モニター用バラトロン+モニター固定

\* swage 4BMRG : Cv&lt;0.30/6回転

\* AC をひく

\* 専用ではなく、標的領域汎用 distributor から

## \* BDC1, 2

\* 内部/外部配線ほぼ完成

\* swage 4BMG : Cv&lt;0.019/6回転

\* 1気圧付近で最大2 L/min (i-C4H10)

\* valcom 追加

\* バイパス追加 : ガス系配線終了

\* 真空引き+圧力コントロールの試験

\* 50, 100 torr OK

\* ASD-PS 配線

\* blx1, blx1p, blx2, blx2p

\* bly1, bly1p, blx2, blx2p



- \* b2x1, b2x1p, b2x2, b2x2p
- \* b2y1, b2y1p, b2x2, b2x2p
- \* VME-TDC 配線
  - \* b1x1, b1x1p, b1x2, b1x2p (left)
  - \* b1y1, b1y1p, b1y2, b1y2p
  - \* b2x1, b2x1p, b2x2, b2x2p
  - \* b2y1, b2y1p, b2y2, b2y2p (right)